

Вакуумные системы для анализа поверхности

XPS, ARPES, NAP-XPS, SPM,
PEEM/LEEM, HAXPES, AES, MBE, UPS,
SIMS и другие

Насосы, компоненты
и комплектующие вакуумных систем

Системы позиционирования,
манипуляторы и трансляторы



Рентгеновские дифрактометры

Настольные порошковые
дифрактометры

Дифрактометры с точечным
и линейным детектором

Дифрактометры с высоким
разрешением для анализа тонких
пленок

Монокристалльные дифрактометры



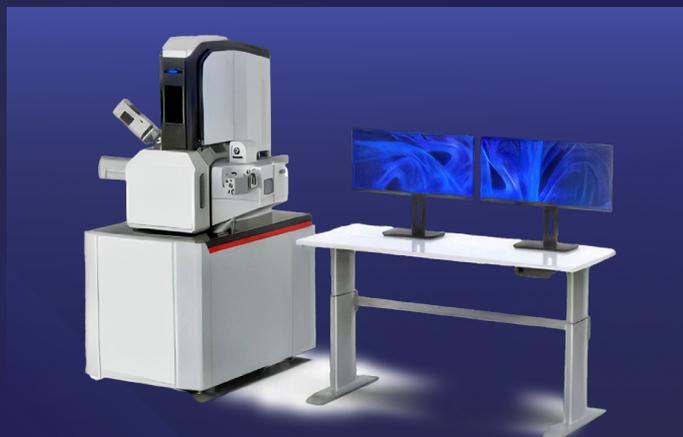
Источники излучения, испарители и детекторы

Рентгеновские, УФ, ионные
и плазменные источники

Электронные источники
и электронно-лучевые испарители

Рентгеновские детекторы
и детекторы электронов





Сканирующие электронные микроскопы

«Рабочие лошадки» с вольфрамовым катодом

Высокоразрешающие СЭМ с катодом Шоттки

Множество опций и приставок: EDS, EBSD, CL, WDS, литография, STM, AFM, столики нагрева/ охлаждения, микро- наноманипулятор

Пробоподготовка



Металлографические шлифовочные/ полировочные машины

Металлографические отрезные станки

Металлографические запрессовщики

Установки нанесения проводящих покрытий

Системы ионного утонения образцов

Термообработка и термоанализ

Системы Вакуумной Термообработки:

Искровое плазменное спекание

Горячее изостатическое прессование

Дуговая плавка

Закалка, пайка, сварка

Спиннингование

Рост кристаллов

Газофазное осаждение и др.

Системы Термоанализа (TDA, DSC, STA, TMA и др.)

